

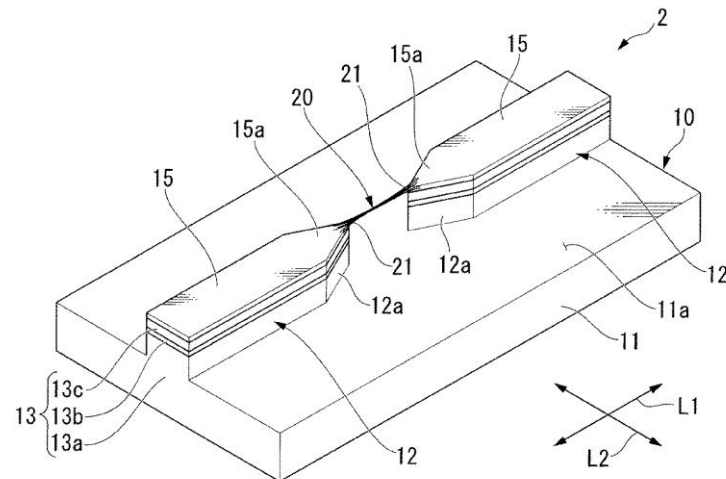
公開番号／特許登録番号	特許6035087
発明の名称	ガスセンサ、ガス測定装置、及びガスセンサの製造方法
出願人または特許権者	セイコーインスツル株式会社 国立大学法人 東京大学

発明の内容（概要）

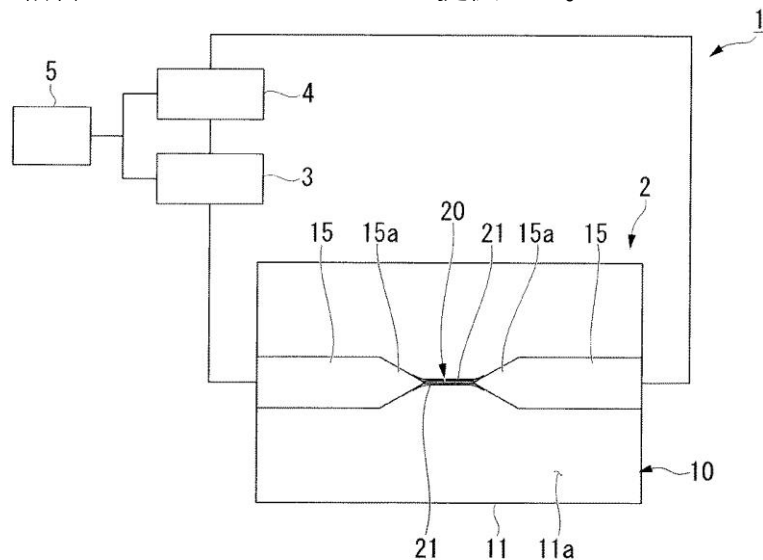
本発明は、カーボンナノチューブを利用してガスを検出するガスセンサセンサの製造方法に関するものである。

【課題】 特定のガスを選別的に測定することができるガスセンサを提供することである。

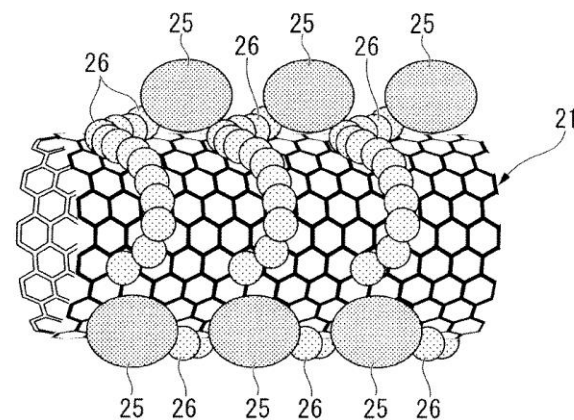
【解決手段】 支持基板10と、支持基板上に間隔をあけて向かい合うように配設された一対の金属電極15と、一対の金属電極間に架橋されるように形成され、半導体性の複数のカーボンナノチューブ21同士が集合したナノチューブ束20と、を備え、カーボンナノチューブの表面には、金属材料又は半導体からなるナノ粒子が生体分子を介して修飾され、生体分子は、カーボンナノチューブ及びナノ粒子に対してそれぞれ特異的に結合しているガスセンサ2を提供する。



ガスセンサの斜視図



ガス測定装置の構成図



ガスセンサの斜視図に示すナノチューブ束を構成するCNTの拡大図